



⑯ Offenlegungsschrift
⑯ DE 44 07 518 A 1

⑯ Int. Cl. 6:
G 01 B 11/24
G 01 B 11/14
G 01 B 11/02

DE 44 07 518 A 1

⑯ Aktenzeichen: P 44 07 518.9
⑯ Anmeldetag: 7. 3. 94
⑯ Offenlegungstag: 14. 9. 95

⑯ Anmelder:

Intecu Gesellschaft für Innovation, Technologie und
Umwelt mbH, 07549 Gera, DE

⑯ Vertreter:

Popp, E., Dipl.-Ing.Dipl.-Wirtsch.-Ing.Dr.rer.pol.;
Sajda, W., Dipl.-Phys., 80538 München; Bolte, E.,
Dipl.-Ing., 28209 Bremen; Reinländer, C., Dipl.-Ing.
Dr.-Ing.; Bohnenberger, J., Dipl.-Ing.Dr.phil.nat.,
80538 München; Möller, F., Dipl.-Ing., 28209 Bremen;
Kruspig, V., Dipl.-Ing., Pat.-Anwälte, 80538 München

⑯ Erfinder:

Just, Gerhard, Dr.rer.nat., 07549 Gera, DE; Grunert,
Frank, 07552 Gera, DE; Nauschütz, Karl-Heinz, 07549
Gera, DE; Blochinger, Jens, 07552 Gera, DE; Posern,
Heinrich, 08373 Remse, DE

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑯ Vorrichtung und Verfahren zum berührungslosen Vermessen dreidimensionaler Objekte auf der Basis
optischer Triangulation

⑯ Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung
zum berührungslosen Vermessen dreidimensionaler Objekte
auf der Basis der optischen Triangulation. Erfindungsgemäß
sendet eine Strahlungsquelle gebündelte Strahlung auf die
Oberfläche des zu vermessenden Objektes. Diese Strahlung
wird reflektiert und die Remission mittels Strahlungsdetektoren
erfaßt. Durch entsprechende Antriebsvorrichtungen
wird die gesamte Oberfläche des zu vermessenden Objektes
kontinuierlich abgetastet. Neben einer Drehung des Objektes
mittels eines Drehtisches erfolgt eine Bewegung in
vertikaler bzw. y-Richtung eines Abtastkopfes, welcher im
wesentlichen die Strahlungsquelle und die Strahlungsdetektoren
sowie zugeordnete Optiken enthält. Um Hinterschnei-
dungen, Sacklochbohrungen oder andere, schlecht erkenn-
baren Oberflächenabschnitte des Objektes scannen zu kön-
nen, besitzt der Abtastkopf Mittel zum Verschwenken,
Kippen und/oder Drehen, wodurch unterschiedliche Abtast-
bzw. Blickwinkel mit geringem mechanischem Aufwand
realisiert werden können und die Abtastgenauigkeit bzw. die
Auflösung der Meßvorrichtung verbessert wird.

DE 44 07 518 A 1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

BUNDESDRUCKEREI 07. 95 508 037/108

9/29

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum berührungslosen Vermessen dreidimensionaler Objekte auf der Basis optischer Triangulation gemäß dem Oberbegriff der Patentansprüche 1 bzw. 9.

Verfahren zum berührungslosen Vermessen der Außenkonturen von dreidimensionalen Objekten mittels elektromagnetischer Strahlung auf der Basis optischer Triangulation sind bekannt. Hierbei befindet sich das Objekt auf einem Drehteller und wird mittels einer Abtasteinheit, die relativ zum Drehteller in x- und z-Richtung bewegbar ist und eine Strahlungsquelle sowie Strahlungsdetektoren enthält, abgetastet. Bei derartigen Vorrichtungen wird der von der Abtasteinrichtung ausgehende und am Objekt reflektierte Meßstrahl hinsichtlich des Auftreffpunktes auf einen in der Abtasteinrichtung angeordneten Sensor untersucht, wobei das Sensorausgangssignal mit einer Auswerteeinheit rechnergestützt weiterverarbeitet wird, um entsprechende Informationen über die Objektentfernung, x- und z-Lage der Abtasteinheit und der Drehlage des Drehtellers zu erfassen, um daraus wiederum dreidimensionale, digitale Daten zur Verfügung zu stellen.

Derartige Daten werden dann abgespeichert, um in einem sogenannten CAD-System, z. B. zur Steuerung einer numerischen Werkzeugmaschine zur Verfügung zu stehen.

Die Vermessung dreidimensionaler Objekte mittels optoelektronischer Sensorik und auf der Basis der Triangulation ermöglicht eine genaue Datenerfassung, welche schneller möglich ist, als dies mit mechanischen Abtastvorrichtungen realisiert werden kann.

Bei der aus der DE 39 10 855 C2 vorbekannten Vorrichtung zum Vermessen dreidimensionaler Objekte soll der konstruktive Aufwand, insbesondere zur Bewegung der Abtasteinheit in X- und Z-Richtung vereinfacht werden. Gemäß der dortigen Lösung wird ein handelsüblicher EDV-Plotter als X- und Z-Schlitten für die Abtasteinheit verwendet, welcher auf einem L-förmigen Grundgestell montiert ist. Der waagerechte Schenkel des L-förmigen Grundgestells dient der Befestigung des Drehtellers, wobei der vorerwähnte EDV-Plotter auf dem senkrechten Schenkel des Grundgestells angeordnet ist.

Ein Problem ergibt sich dann, wenn mit der dort gezeigten Vorrichtung Objekte vermessen werden sollen, die Hinterschneidungen oder verdeckte Stellen aufweisen. In diesem Falle muß nämlich die Meßeinheit zusätzlich in x-Richtung verfahrbar sein. Eine derartige, in zwei Ebenen senkrecht zueinanderstehende Verfahrbarkeit erhöht jedoch zum einen den mechanisch konstruktiven Aufwand und führt zum anderen zu einer Instabilität und mechanischen Schwingungen der gesamten Meßeinheit. Darüberhinaus ist es außerordentlich schwierig, in zwei Ebenen möglichst schnell mit hoher Dynamik Lageveränderungen vorzunehmen, wobei zu bedenken ist, daß Ungenauigkeiten in der Positionierung der Abtasteinheit mit den Sensoren bzw. der Strahlungsquelle eine erhebliche Verschlechterung der Meßgenauigkeit nach sich ziehen.

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung und ein Verfahren zum berührungslosen Vermessen dreidimensionaler Objekte auf der Basis optischer Triangulation anzugeben, welche es gestatten, ein Objekt mit hoher Präzision auch dann zu vermessen, wenn dieses Objekt Hinterschneidungen, verdeckte Stellen, Sacklöcher oder ähnliches aufweist.

Die Lösung der Aufgabe der Erfindung erfolgt mit den Merkmalen der Patentansprüche 1 und 9, wobei die Unteransprüche mindestens zweckmäßige Ausgestaltungen und Weiterbildungen des Gegenstandes der Erfindung zeigen.

Der Grundgedanke der Erfindung besteht darin, einen Abtastkopf auszubilden, welcher in vertikaler, d. h. in y-Richtung linear bewegbar ist und der weiterhin eine Antriebseinheit aufweist, welche ein vorgegebenes Verschwenken, Kippen und/oder Drehen des Abtastkopfes an einer jeweils vorgegebenen y-Position, d. h. an einem Fixpunkt ermöglicht.

Gemäß einem weiteren Gedanken der Erfindung erfolgt die Bewegung des Drehtisches, welcher der Aufnahme des zu vermessenden Objektes dient, quasi-kontinuierlich, wodurch unerwünschte Schwingungen des Objektes oder der gesamten Vorrichtung mit dem Nachteil geringer Meßgenauigkeit, wie dies bei schrittweisem Drehantrieb gegeben ist, vermieden werden.

Das dreidimensionale Vermessen erfolgt dann dadurch, daß das auf dem Drehteller bzw. Drehtisch befindliche Objekt auf einer Umlaufslinie, nämlich einem Ring, punktweise abgetastet wird. Nach jeder Umdrehung des Drehtisches wird der Abtastkopf in y-Richtung um einen vorgegebenen Schritt weitertransportiert. Anschließend erfolgt das Abtasten eines nächsten Ringes und die entsprechende Datenübertragung. Die vorstehende Verfahrensweise wird so lange wiederholt, bis das gesamte Objekt umfangsmäßig abgetastet ist. Die an eine nachgeordnete Datenverarbeitungseinrichtung übertragenen Informationen beschreiben demnach Punkte auf der Oberfläche des Objekts als X-, Y-, Z-Koordinaten.

Die vorstehend beschriebene Abtastung wird mindestens in einer vorgegebenen Winkelstellung des Abtastkopfes durchgeführt. Es hat sich herausgestellt, daß bei sehr ungleichmäßigen Objekten eine Mehrfachabtastung, quasi zur Bildung einer Abtastpunktswolke, in unterschiedlichen Winkelstellungen zweckmäßig ist. Mit Hilfe dieser Mehrfachabtastung wird ein spezielles Abtastfenster gebildet, wobei die in diesem Fenster erhaltene Vielzahl von Informationen in der Datenverarbeitungseinrichtung zu einer eindeutigen Aussage über die Konfiguration bzw. Oberflächengestaltung des Objektes eben an dieser Stelle zusammengefügt wird.

Durch die Möglichkeit des Schwenkens der Blickrichtung des Abtastkopfes um die Vertikalachse um einen bestimmten vorwählbaren Winkel können unterschiedliche Blickrichtungen auf das Objekt eingestellt werden. Hierdurch können in vorteilhafter Weise verdeckte Oberflächenteile durch Messungen mit Hintergriff erkannt werden. Damit können ansonsten nicht einsehbare Flächenstücke des Objektes, besonders bei mehrfach zusammenhängenden Oberflächen, also z. B. Oberflächen mit Durchgangslöchern, ausreichend genau abgesucht werden. Durch eine Einstellung der Blickrichtung des Abtastkopfes durch Kippen desselben um im wesentlichen 90° um die Rollachse der Beobachtungsrichtung und Schwenken der Meßkopfblickrichtung in der Neigungsachse um einen vorwählbaren Winkel können schlecht vermeßbare Oberflächenstücke des Objektes, wie z. B. achsennahe oder weitgehend horizontale bzw. waagerechte Oberflächenbereiche erfaßt werden.

Durch mehrfach vorhandene Empfängerbaugruppen, d. h. Strahlungsdetektoren und entsprechende Optiken, kann eine höhere Signalwahrheit erreicht werden. Dies dient damit der Verbesserung der Signalsicherheit bei Reflexionsfaktorproblemen durch entsprechende logi-

sche Prüfalgorithmen. Letzteres wird hierdurch die horizontale Ortsgenauigkeit durch geometrisches Ausschalten des Symmetriefehlers verbessert sowie der Absolutfehler verringert.

Ein weiterer, wesentlicher Grundgedanke der Erfindung besteht darin, eine dynamische Regelung der Lichtleistung der verwendeten Strahlungsquelle, z. B. einer Laserdiode, vorzunehmen, wodurch die Deutungswahrscheinlichkeit des reflektierten Lichtsignals auf den Strahlungsdetektoren und damit die Meßgenauigkeit erhöht werden kann. Durch eine einfache, steuerbare Verlängerung der Integrationszeit der als Strahlungsdetektoren verwendeten CCD-Zeilen können auch weit entfernte, winkelmäßig sehr ungünstige und/oder schwach reflektierende Objekte sicher vermessen werden.

Die Gewinnung der Tiefeninformation aus dem erhaltenen Gesamtignal des CCD-Zeilensignals erfolgt mit einer Entfaltung bzw. Teilentfaltung, z. B. durch entsprechende analoge Signalverarbeitung, bei welcher zunächst hohe Frequenzen ausgefiltert werden, differenziert, geglättet, nochmals differenziert und dann von der geglätteten Ursprungsfunktion die gewichtete zweite Ableitung subtrahiert wird. Alternativ kann eine digitale Entfaltung oder Defuzzifizierung erfolgen.

Das erfindungsgemäße Verfahren und die zugehörige Vorrichtung sollen nunmehr anhand eines Ausführungsbeispiels und von Figuren näher erläutert werden.

Hierbei zeigten:

Fig. 1 eine prinzipielle Darstellung des optischen Triangulationsverfahrens mit dem Ziel der Verdeutlichung des Wirkungsprinzips des Abtastkopfes und

Fig. 2 den prinzipiellen Aufbau der Vorrichtung mit den angedeuteten Möglichkeiten des Verschenkens des Abtastkopfes.

Mit der Fig. 1 soll zunächst das Wirkungsprinzip des Abtastkopfes und die damit realisierte optische Triangulation kurz erläutert werden.

Zwei CCD-Zeilen 1 sind in vorgegebener Winkelposition im wesentlichen symmetrisch zum Strahlengang einer als Strahlungsquelle dienenden Lasers 2 angeordnet. Jeder CCD-Zeile 1 ist ein entsprechendes Objektiv 3 zugeordnet. N, M und O sind Meßpunkte des zu vermessenden Objektes und S_M stellt die Meßgröße, die mittels der CCD-Zeilen 1 gewonnen wird, dar.

Das vom Laser 2 ausgesandte gebündelte Licht wird von der Oberfläche des abzutastenden Objektes reflektiert. Der Remissionsanteil wird innerhalb des Meßbereiches durch die Optik 3 erfaßt und als Meßgröße S_M von den jeweiligen CCD-Zeilen 1 ausgewertet. Die auf der jeweiligen CCD-Zeile 1 ermittelte Position wird als Maß für die Bestimmung der Entfernung des abgetasteten Punktes auf der Oberfläche des dreidimensionalen Körpers benutzt.

In einer Ausgestaltung der Erfindung sind die CCD-Zeilen 1 und/oder die Objektive 3 bewegbar. Die Strahlung des Lasers 2 wird mit einer nicht gezeigten automatischen Fokussierung dynamisch fokussiert, um bei Objekten mit unterschiedlichem Durchmesser die Meßgenauigkeit zu erhöhen.

Durch die mehrfach vorhandenen Empfängerbaugruppen bzw. CCD-Zeile 1 mit den zugehörigen Objektiven 3 wird die Fehlerwahrscheinlichkeit durch das Ausschalten meßprinzipbedingter Fehler verringert und Probleme bei unterschiedlich reflektierenden Oberflächen oder Oberflächenteilen des Objektes ausgeschalten.

Es liegt im Sinne der Erfindung, die Meßgenauigkeit

durch Meßwertakkumulation und Mittelwertbildung zu erhöhen und die Auswirkungen von Rauschen zu minimieren.

Für quasidynamische bzw. zeitaufgelöste Messungen durch fortlaufende Wiederholungsmessungen mit außerordentlich schnellem Meßwert- bzw. Datenfluß können auch einzelne Punkte, Ringe, Spiralbahnen oder vertikale Linien als Quasiortsraum-Meßwertfenster für die Analyse des Zeitverhaltens, z. B. für das Eigenschwingverhalten, vorgewählt werden. Die CCD-Zeilen 1 sind in jeweils drei Translations- und Rotationsrichtungen justierbar (nicht gezeigt).

Die Meßgenauigkeit kann weiterhin dadurch erhöht werden, daß eine speziell geformte, kombinierte Loch- und Ringblende bzw. ein entsprechender Blendsatz vorhanden und ausgestaltet ist, daß sich als Superposition der Beugungerscheinungen die weitgehend glatteste Hüllkurve der Lichtfleckstruktur auf dem Objekt ergibt.

Die für den Laser 3 verwendete Mikrofokusskopik gestattet die Ausbildung einer Beleuchtungsfläche am Objekt mit einem Durchmesser kleiner gleich 0,2 mm. Die Auflage für die Objektive 3 ist bezogen auf die Anordnung der CCD-Zeilen 1 separat und insgesamt quer schwenkbar für entsprechende Winkel gegenüber der Lichtwellenachse in einem Bereich von 5 bis 20°. Anstelle des verwendeten Lasers kann alternativ auch eine Xenon-Hochdrucklampe mit einem entsprechenden Kollimator zur Einstellung der Strahlaille und zur Bildung einer Quasipunktlichtquelle eingesetzt werden.

Der Laser 2, der Kollimator und der Kollimatorantrieb sind als einheitliche optische Fokussiereinheit ausgebildet. Die zur Fokussierung erforderlichen, beweglichen Kollimatorelemente sind vollständig im Kollimatorantrieb aufgehängt.

Der eigentliche Kollimatorantrieb setzt sich aus der Antriebseinheit und der Kollimatoraufhängung zusammen, welche im wesentlichen aus einer eine Gegenkraft erzeugenden Federeinheit besteht. Die beweglichen Teile des Kollimatorantriebes und der Kollimatoraufhängung sind in Leichtbauweise, vorzugsweise unter Verwendung von Kunststofflaminaten, ausgeführt. Mittels des speziellen Kollimatorantriebes kann die Einstellung des Fokuspunktes auf dem Objekt durch den Kollimator und mit einer Dynamik bis hinein in den Kilonertzbereich erfolgen.

Die Antriebseinheit des Kollimators ist ein Linearantrieb mit hohem Beschleunigungsvermögen durch geringe Masse bei hohen Einstellgeschwindigkeiten. Der Antrieb selbst sitzt direkt auf der optischen Achse, wodurch eine direkte Kraftübertragung und Minimierung sekundärer Bahnfehler erreicht wird. Der Antrieb ist weiterhin als ein magnetisches Tauchspulensystem ausgebildet, wobei die Tauchspule eine angenäherte lineare Kennlinie aufweist. Der vorstehend erwähnte Antrieb wird unter Vorlast betrieben. Dies erlaubt nach erfolgter mechanischer Grundeinstellung der Fokussiereinheit, diese elektrisch fein zu justieren und gegebenenfalls optimale Bereiche des Zusammenwirks der Vorspannfederkennlinie und der Kennlinie des eigentlichen Antriebes auszuwählen.

Der Kollimatorantrieb wird elektrisch derart angesteuert, wobei sich der Ablenkstrom PID-artig aus einem Beschleunigungsstrompuls, dem eigentlichen Ablenkstrom und einem kurzen Abbremsstrompuls überlagert von einem ständig anliegenden Justiergrundstrom zusammensetzt. Hierdurch kann äußerst schnell und einfach justiert und fokussiert werden.

Die Bestimmung der Stromrichtung zur Magnetantriebssteuerung erfolgt durch Auswertung des Meßsignals eines optischen Entfernungsmessers und über Look-up-Tabellen und anschließende Berechnung mittels eines Einchip-Mikrorechners. Unter Beachtung des Fokussierpunktverlaufes kann die Stromsignalbereitstellung für den Antrieb adaptiv oder auf Erfahrungswerten aufbauend quasi fuzzylogisch bereitgestellt werden. Hierdurch ist eine b sonders schnelle, hoch dynamische Fokussierung möglich.

Die Fig. 2 dient der Erläuterung der Vorrichtung zum Vermessen dreidimensionaler Objekte und zeigt ein im wesentlichen L-förmiges Grundgestell 4, auf dessen waagerechten Teil ein Drehteller 5 befestigt ist. Im waagerechten, fußförmigen Teil 4 befindet sich auch der Antrieb für den Drehteller 5. Ein vertikaler, in y-Richtung gebildeter Schenkel 8 des Gestells nimmt die Mitte zum Vertikalanztrieb des Abtastkopfes 6, der die Strahlungsquelle (Laser) 2 und die Empfänger (CCD-Zeilen) 1 umfaßt, auf.

Der Abtastkopf 6 verfügt über einen im einzelnen nicht gezeigten Schwenkantrieb.

Die gesamte mechanische Grundkonstruktion ist mit schwingungsdämpfenden Mitteln versehen, die Stöße kleiner gleich 3g vom Geräteinneren abhalten.

Der Vertikal- und Schwenkantrieb ist als Spindelantrieb ausgelegt, wodurch eine Positionsgenauigkeit im Bereich von kleiner gleich 15 μm erreicht werden kann. Der Antrieb des Drehtellers 5 besteht aus einem Zahnräderantrieb und einem entsprechenden Motor, der über einen Taktgeber betrieben wird. Die Winkelgenauigkeit beträgt 2048 Impulse je Umdrehung. Die unterschiedlichen Möglichkeiten des Verschwenkens sind in der Fig. 2 angedeutet. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, daß der Abtastkopf 6 quasi in der Achse der Strahlungsquelle 2 verdreht wird.

Die Kopfschwenkbarkeit in der x-Ebene beträgt bei einem Ausführungsbeispiel $\pm 20^\circ$, die Kippbarkeit in der y-Ebene $\pm 10^\circ$.

Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung können Objekte mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm abgetastet werden, wobei das Abtasteraster im Bereich von 0,05 bis 6,4 mm liegt. Die Auflösung in Meßrichtung liegt im wesentlichen bei 50 μm . Die Wellenlänge der verwendeten Strahlung beträgt 670 nm und die Meßfrequenz 5 kHz.

Das Scannobjekt 7 wird mit nicht gezeigten Spannmitteln auf dem Drehteller 5 befestigt. Mit Hilfe des Drehtellers 5 bzw. des Drehtellerantriebes dreht sich das dreidimensionale Objekt 7 am Abtastkopf 6 in waagerechter Richtung vorbei. Es sei angemerkt, daß vor teilhaftweise zur Funktionsüberwachung der Antriebe berührungslos arbeitende Positionssensoren vorgesehen sind. Der Abtastkopf 6 wird, wie bereits erwähnt, von einem Vertikalanztrieb in senkrechter Richtung am Abtastobjekt 7 vorbeigeführt. Mit dem erwähnten Schwenkkipp- bzw. Drehantrieb sind unterschiedliche Winkel lagen des Abtastkopfes 6 hin zum Abtastobjekt 7 einstellbar. Hierdurch gelingt es, auch in z-Richtung parallele Oberflächen zu scannen bzw. die Auswirkungen von Hinterschneidungen oder Sacklochbohrungen oder ähnliches beim Scannen des Objektes zu vermeiden.

Die Abtastung erfolgt mindestens in einer Winkelstellung des Abtastkopfes 6. Bei sehr ungleichmäßigen Objekten wird zweckmäßigerweise eine Mehrfachabtastung bei konstantem y-Fixpunkt in unterschiedlichen Winkelstellungen des Abtastkopfes 6 durchgeführt.

Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung und dem zugehörenden Verfahren zum berührungslosen Vermessen dreidimensionaler Objekte auf der Basis optischer Triangulation kann unter Anwendung spezieller Kinematiken auch die Konfiguration mehrfach zusammenhängender Oberfläche bestimmt werden. Die kinematischen Parameter sind frei wählbar und können quasi kontinuierlich durchfahren werden. So ist die Drehung des Drehtellers, auf welchem das Objekt befindlich ist, beispielsweise in Schritten von 0 bis 4 Umdrehungen je Sekunde einstellbar. Zusätzlich kann eine Verschiebung des Drehtisches in Meßkopfrichtung vorgenommen werden. Ein Verschwenken und Kippen bzw. Verdrehen des Abtastkopfes ermöglicht die Erfassung verdeckter Flächengebiete. Der Rasterabstand in Vertikal- und in Objektmfangsrichtung liegt bei im wesentlichen 0,1 mm.

Alles in allem können mit dem erfindungsgemäßen Verfahren geometrisch komplizierte und mathematisch schwer beschreibbare Objekte, die über Hinterschneidungen, Sacklöcher und dergleichen verfügen, mit geringem Aufwand räumlich erfaßt werden, wobei die bereitgestellten 3D-Binärdaten von einer nachgeordneten CAD-Workstation weiter verarbeitet werden können. Dadurch, daß nur ein einziger linearer, nämlich ein Vertikalanztrieb verwendet werden muß und zusätzlich in konstruktiv einfacher Weise nur Schwenkkipp- bzw. Drehbewegungen eines Abtastkopfes an einem jeweiligen vertikalen Fixpunkt ausgeführt werden, kann eine höhere Genauigkeit bei der Positionierung des Abtastkopfes, bezogen auf einen vorgegebenen Punkt der Oberfläche des zu vermessenden Objektes, erfolgen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum berührungslosen Vermessen dreidimensionaler Objekte auf der Basis optischer Triangulation umfassend
einen bewegbaren Abtastkopf mit mindestens einer Strahlungsquelle, Strahlungsdetektoren und einer Optik,
einen Drehtisch zur Aufnahme des zu vermessenden Objektes sowie
eine Datenverarbeitungs- und Steuerungseinheit und Antriebseinrichtungen dadurch gekennzeichnet, daß der Abtastkopf (6) mittels eines ersten Antriebes, in vertikaler, d. h. in y-Richtung bewegbar sowie durch einen zweiten Antrieb um eine vorgegebene Winkellage an einem wählbaren Fixpunkt in der x-Ebene verschwenkbar ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Drehtisch (5) und dem Abtastkopf (6) Mittel zum Erzeugen einer Relativbewegung in z-Richtung vorgesehen sind.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Abtastkopf (6) um eine vorgegebene Winkellage an einem wählbaren Fixpunkt in der y-Ebene kippbar ist.
4. Vorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Abtastkopf (6) um eine vorgegebene Winkellage an einem wählbaren Fixpunkt in der z-Ebene drehbar ist.
5. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Abtastkopf (6) mehrere Strahlungsdetektoren (1) und Abbildungsoptiken (3) zum doppelten oder mehrfachen Strahlungsempfang und zur Mehrfachtriangulation aufweist.

6. Vorrichtung nach einem Ansprache 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Fixpunkte durch vertikale Bewegung des Abtastkopfes (6) kontinuierlich einstell- bzw. wählbar sind. 5

7. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die mindestens eine Strahlungsquelle (1) eine Laserdiode, LED oder Xenon-Hochdrucklampe, ist. 10

8. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Strahlungsdetektoren CCD-Zeilen (1) sind. 10

9. Verfahren zum berührungslosen Vermessen dreidimensionaler Objekte auf der Basis optischer Triangulation, wobei die von einer Strahlungsquelle ausgesendete, gebündelte Strahlung die Oberfläche 15 des Objektes abtastet und von dieser reflektiert wird und die Remission mittels Strahlungsdetektoren erfaßt wird und die Strahlungsquelle sowie die Strahlungsdetektoren in einem bewegbaren Abtastkopf angeordnet sind, gekennzeichnet durch 20

- eine Bestimmung des Ortes der reflektierten Strahlung auf mindestens eine als Strahlungsdetektor verwendete CCD-Zeile zur Ermittlung des Maßes der Entfernung des abgetasteten Punktes auf der Oberfläche des Objektes; 25
- eine Drehung des Objektes im Objektabstand zum umfangsmäßigen, ringweisen, waa-30
- gerechten, in X-Richtung erfolgenden Abta-35
- sten des Objektes, wobei nach jeder Umdrehung ein schrittweises, fortlaufendes Abtasten in y-Richtung erfolgt und die derart ringweise gewonnenen Daten abgespeichert und zur dreidimensionalen Rekonstruktion des Objektes mittels einer Datenverarbeitungseinheit 35 verwendet werden,
- eine Wiederholung des ringweisen Abta-40
- stens bei einem vorgegebenen y-Abtastschritt unter unterschiedlichen Winkelstellungen des Abtastkopfes zur Vermeidung der Auswirkungen von Hinterschneidungen, verdeckten Stellen bzw. x-parallelene Ebenen bzw. Flächen des Objektes. 45

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Datenverarbeitungseinheit dreidimensionale Dateien des Objektes derart bereitstellt, daß diese Dateien bzw. Daten über ein Interface von einer Standard-CAD-Workstation weiterverarbeitet werden können. 50

11. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Strahlungsquelle mittels Gesamtlichtstrommessung so nachgeregelt wird, daß die Lichtsignaldynamik am Strahlungsdetektor nahezu gleich ist, wodurch das Signal-Rausch-Verhältnis des Strahlungsdetektor-Ausgangssignal, konstant 55 gehalten und die Meßgenauigkeit erhöht wird. 55

12. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Ausgangssignal der mindestens einen CCD-Zeile analog oder digital entfaltet und eine Schwerpunktbestimmung zur Meßsignalbe-60 wertung durchgeführt wird. 60

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

- Leerseite -

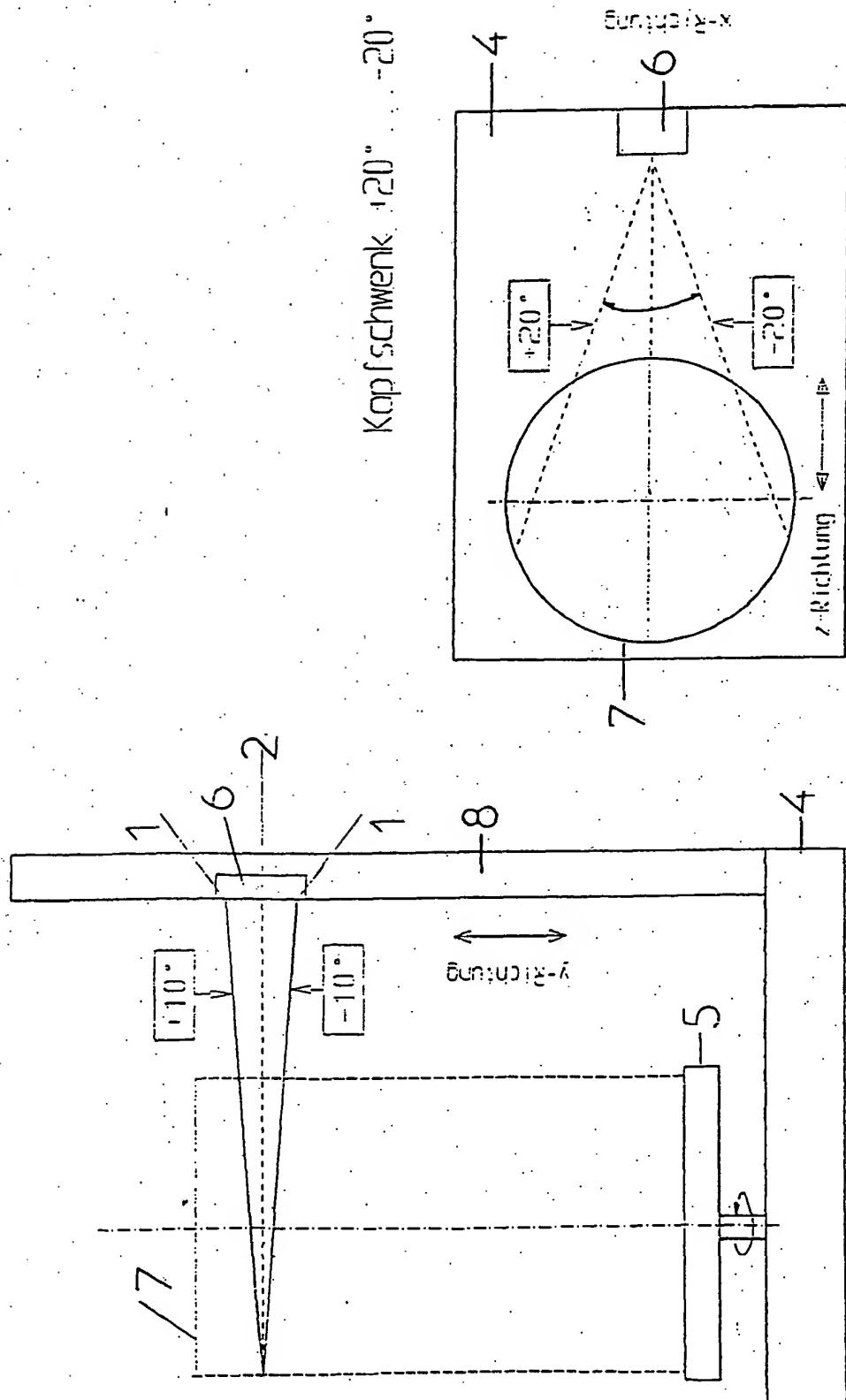


Fig. 2

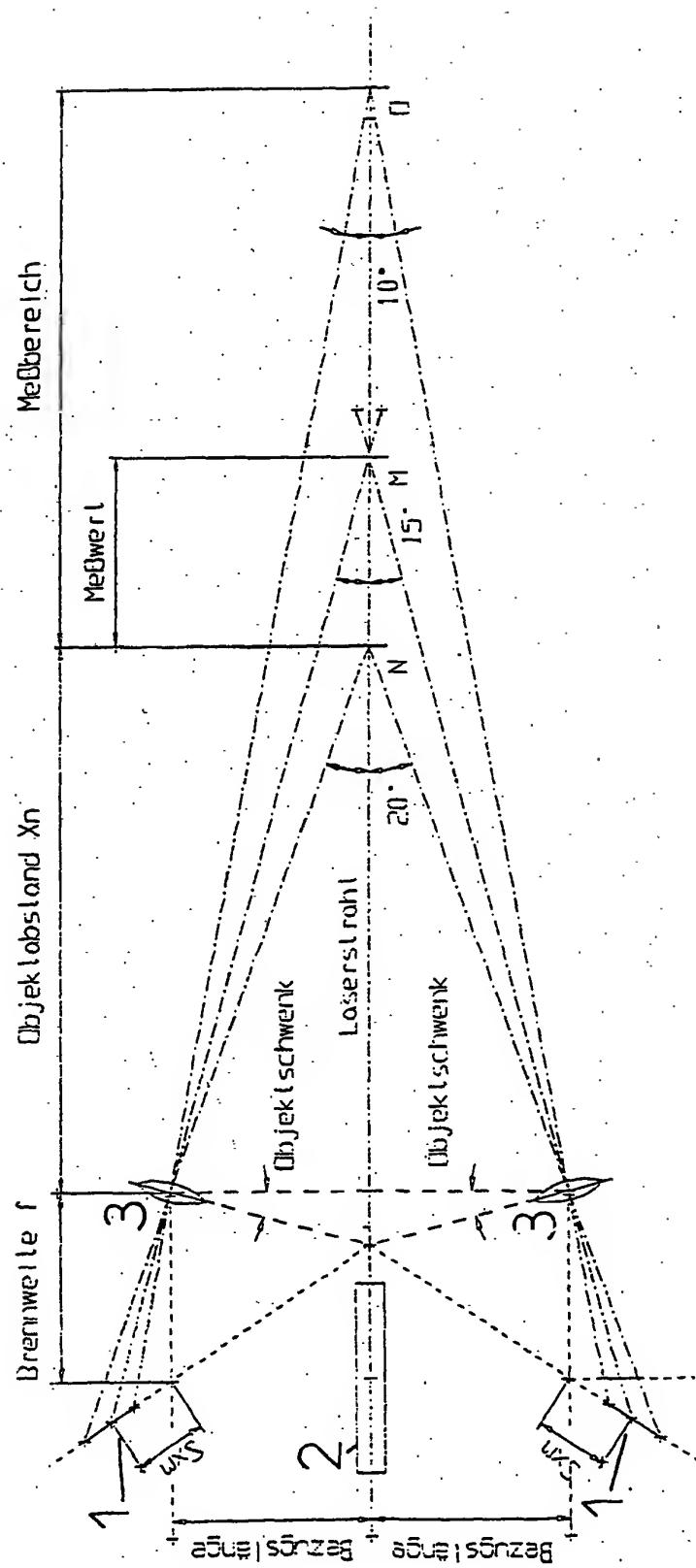


Fig. 1